

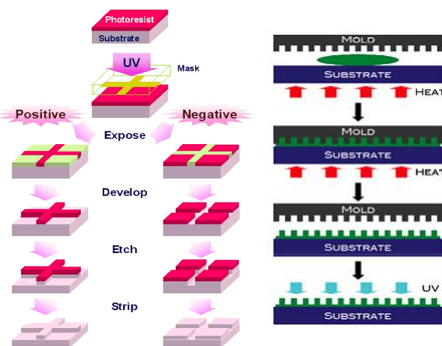


CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO Y NANOTECNOLOGÍAS

Sistema de alineación de mascarillas (EVG620)

Descripción

El sistema EVG620 es una herramienta de doble uso diseñada para realizar procesos de fotolitografía de doble cara, así como procesos de litografía por nanoimpresión NIL (*Nanoimprint Litography*).



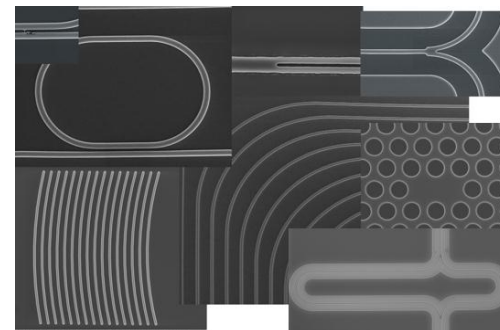
Aplicaciones

- Transferencia de patrones a escala micrométrica con una resolución de 1 a 5 μm (fotolitografía).
- Transferencia de patrones a escala nanométrica con una resolución menor a 50 nm (NIL).
- Alineación litográfica por ambas caras.



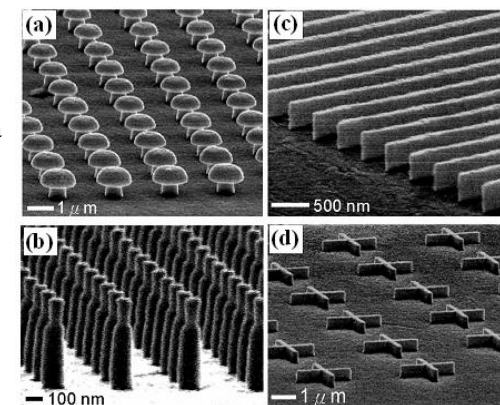
Resultados

- Fabricación de micro y nano sistemas electromecánicos.
- Desarrollo de micro y nano estructuras, microcanales, sensores de presión, etc.



Beneficios

- Fabricar dispositivos a escala manométrica.



Contacto

Dr. Jacobo Esteban Munguía Cervantes
jmunguia@ipn.mx
Tel. 57296000 Ext. 57513

